

SPI

Interferometer für die Ebenheitsprüfung von geläppten und feingeschliffenen Oberflächen



SPI Sichtprüfinterferometer ermöglichen die Prüfung der Ebenheit geläppter oder feingeschliffener Oberflächen, die mit dem Planglas keine Interferenzen zeigen. Das SPI nutzt das Prinzip des schrägen Lichteinfalls und zeigt damit Lichtbänder mit hohem Kontrast, sowohl bei raueren als auch bei polierten Oberflächen. Die Teile werden zur

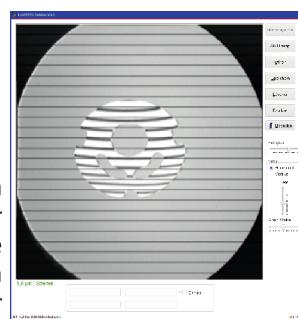
Prüfung einfach auf eine Glasfläche an der Oberseite des SPI gelegt. Teil und Lichtbänder werden vergrößert auf einem Monitor oder Laptop dargestellt. Die Beurteilung der Lichtbänder ist gleich wie der Prüfung mit dem Planglas: gerade, parallele und äquidistante Lichtbänder zeigen eine hohe Ebenheit an.

Die SPI Sichtprüfinterferometer eignen sich zur Aufstellung in der Fertigung, direkt neben der Bearbeitungsmaschine. Mit dem mitgelieferten Intdok Programm ist eine Dokumentation der Ebenheit möglich.



Interferogram einer Al_2O_3 -Regelscheibe, die als Bitmap im Intdok abgespeichert werden kann

Intdok Programm
Darstellung einer
Regelscheibe
mit eingeblendetem
horizontalen Gitter



Spezifikationen

	SPI 75D	SPI 130D
Messfeld (Durchmesser)	75 mm	130 mm
Ebenheit der Referenzfläche	besser 0,15 μm (bei konstanten Umgebungsbedingungen)	
Größe (L x B x H)	340 mm x 200 mm x 240 mm	550 mm x 280 mm x 350 mm
Gewicht	9 kg	26 kg